

Title (en)

Method and device for scribing a kinegram structure

Title (de)

Vorrichtung und Verfahren zum Beschreiben einer Kippbildstruktur

Title (fr)

Dispositif et procédé destinés à la description d'une structure d'image pivotante

Publication

**EP 2050574 A1 20090422 (DE)**

Application

**EP 07019074 A 20070927**

Priority

EP 07019074 A 20070927

Abstract (en)

The device has a laser light source (10) that has a control device for modifying an angle at which the laser light emerges from the laser light source, and a holder (6) for a base (5). Two deflection elements (20,20') for the laser light are provided in the beam range of the laser light source. The deflection elements are arranged such that laser light of the laser light source that is deflected, particularly reflected by the deflection elements is incident on the flip image structure of the base accommodated on the holder at a different angle of incidence. An independent claim is included for a method for writing a flip image structure on a base.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Beschreiben einer Kippbildstruktur auf einem Grundkörper, mit einer Laserlichtquelle, welche eine Steuereinrichtung zum gezielten Verändern eines Austrittswinkels des Laserlichtes aus der Laserlichtquelle aufweist, und einer Aufnahme für den Grundkörper. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass im Strahlbereich der Laserlichtquelle zwei Ablenkelemente für das Laserlicht vorgesehen sind, wobei die Ablenkelemente so angeordnet sind, dass von ihnen abgelenktes, insbesondere reflektiertes Laserlicht der Laserlichtquelle jeweils unter einem unterschiedlichen Einfallswinkel auf die Kippbildstruktur des an der Aufnahme aufgenommenen Grundkörpers fällt. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren, das insbesondere mittels einer erfindungsgemäßen Vorrichtung durchgeführt werden kann.

IPC 8 full level

**B41J 2/44** (2006.01); **B42D 15/00** (2006.01); **B42D 15/10** (2006.01)

CPC (source: BR EP US)

**B41J 2/442** (2013.01 - BR EP US); **B42D 25/41** (2014.10 - EP US); **B42D 25/00** (2014.10 - BR EP US); **B42D 25/41** (2014.10 - BR); **B42D 2035/20** (2022.01 - EP); **B42D 2035/44** (2022.01 - EP)

Citation (search report)

- [DA] EP 0219012 A2 19870422 - GAO GES AUTOMATION ORG [DE]
- [A] DE 102005054396 A1 20060601 - GIESECKE & DEVRIENT GMBH [DE]
- [A] WO 2005058610 A2 20050630 - GIESECKE & DEVRIENT GMBH [DE], et al

Cited by

EP4389448A1; WO2024132925A1; FR3046112A1; CN109414949A; EP3594012A1; US11143881B2; WO2017109412A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)

AL BA HR MK RS

DOCDB simple family (publication)

**EP 2050574 A1 20090422; EP 2050574 B1 20090902**; AT E441531 T1 20090915; BR PI0815581 A2 20150218; BR PI0815581 B1 20180918; CA 2694870 A1 20090409; CA 2694870 C 20160329; DE 502007001458 D1 20091015; ES 2331632 T3 20100111; HK 1126725 A1 20090911; KR 20100065163 A 20100615; PL 2050574 T3 20091231; PT 2050574 E 20091117; SI 2050574 T1 20091231; US 2011128345 A1 20110602; US 8477172 B2 20130702; WO 2009043402 A1 20090409

DOCDB simple family (application)

**EP 07019074 A 20070927**; AT 07019074 T 20070927; BR PI0815581 A 20080723; CA 2694870 A 20080723; DE 502007001458 T 20070927; EP 2008006051 W 20080723; ES 07019074 T 20070927; HK 09104949 A 20090602; KR 20107006521 A 20080723; PL 07019074 T 20070927; PT 07019074 T 20070927; SI 200730075 T 20070927; US 67481608 A 20080723